

## Obducat lanserar revolutionerande teknik som möjliggör full industrialisering av NIL

**OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprint litografi (NIL), lanserar ny teknik som innebär att det avgörande steget till full industrialisering av nanoimprint litografi möjliggörs. Tekniken har redan realiserats för Obducats helautomatiserade Sindre system, liksom för Eitre Large Substrate.**

Obducat har under flertalet år arbetat med att etablera en universell lösning som eliminerar problematiken med kompatibiliteten mellan material som används i imprintprocessen. Med den nyutvecklade tekniken kan Obducat belägga den intermediära polymerstampen, kallad IPS<sup>®</sup>, med ett tillräckligt tunt lager av anti-stick molekyler för att säkerställa en mönsterupplösning på nanometernivå samtidigt som önskade anti-stickegenskaper uppnås. Tekniken är baserad på en unik CVD (Chemical Vapour Deposition)-process som utförs vid lågt vakuum och möjliggör en kort process cykel som är särskilt anpassad för implementering vid högvolymtillverkning. CVD-enheten är fullt integrerad i NIL-systemet där IPS<sup>®</sup>:en hanteras automatisk i ett R-2-R (Roll-to-Roll) system. Vidare innebär detta också att CVD-lösningen har kunnat integreras med Obducats demolding system som nyligen beviljades patent i USA.

De många begränsningar som varit förknippade med en kombination av olika imprint material reduceras väsentligt med den nya tekniken. Tydliga fördelar såsom färre defekter, högre yield samt ett ökat antal gånger en IPS kan användas, bidrar till lägre produktionskostnader totalt sett. Anti-sticktekniken har redan realiserats för Obducats helautomatiserade Sindre system, liksom för Eitre Large Substrate. Det är ett teknikframsteg som möjliggör industrialisering, särskilt vad gäller imprint på stora substratytor, då den nödvändiga demolding kraften reduceras avsevärt.

*”Detta är en mycket viktig milstolpe vi har lyckats slutföra. Att kunna göra in-line anti-stickbehandling av IPS:en är en avgörande faktor i att förflytta NIL in i industriell massproduktion. Flertalet av de applikationer bolaget fokuserar på, som har potential att nå stora produktionsvolymmer, kan direkt dra nytta av detta teknikframsteg. Ett applikationsområde som är högaktuellt är bio- och medicinska komponenter men även nästa generations optiska och fotoniska komponenter såsom AR-produkter (Augmented Reality) medför ett behov för imprint av komplexa nanostrukturer på större substrat – något som väsentligen förenklas med vår nya teknik.”*, säger Patrik Lundström, Styrelseordförande.

Obducat har redan färdigställt det första Eitre Large Substrate systemet med integrerad CVD process, en order som bolaget kommunicerade i bokslutskommunikén februari 2019, och erhållit fabriksgodkännande från kunden. Installation av system hos kund kommer att genomföras så snart reserestriktionerna tillåter.

### **För mer information, var god kontakta:**

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  
André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

### **Om Obducat AB (publ)**

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvleder-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på [www.obducat.com](http://www.obducat.com).